



## ContourX-500 3D Optical Profilometer

- 表面テクスチャ計測に完全な自動化対応するベンチトップモデル

ContourX-500 Optical Profilometerは、世界で最も包括的な自動化ベンチトップシステムで、高速で非接触の3次元表面形状測定を実現します。ブルカー独自のチップ/チルト式光学ヘッドを搭載したこのシステムは、トラッキングエラーを最小限に抑えながら、様々な角度から表面形状を測定するための完全なプログラムが可能です。ゲージを搭載したContourX-500は、比類のないZ軸分解能と精度を誇り、ブルカーの白色光干渉法(WLI)フロアスタンド型モデルの業界で認められたすべての利点を、はるかに小さなフットプリントで提供します。

ContourX-500は、業界で最も先進的なユーザーインターフェースを採用しており、事前にプログラムされたフィルターや分析の豊富なライブラリに直感的にアクセスすることができます。新しいUSIユニバーサルスキャンモードを搭載しているため、精密機械加工された表面や半導体プロセスのQA/QC計測から、眼科用やMEMSデバイスの研究開発特性評価まで、幅広い複雑なアプリケーションに簡単にカスタマイズすることができます。

### 比類なき3D計測のための最先端のベンチトップ設計

- 倍率に依存しない業界最高のZ解像度
- エンコードされたXYステージ、オートティップ/チルトヘッド、オートインテンシティで構成された高度な自動化
- スペース効率に優れたフットプリントで統合されたエアアイソレーション

### 優れた測定と分析

- 容易な操作画面で迅速・正確な結果を取得
- 測定・分析ルーチンをカスタマイズするための幅広い自動化機能
- フィルターと分析オプションの最も豊富なライブラリ
- ISO 25178、ASME B46.1、ISO 4287などの業界標準に合わせてカスタマイズされた分析レポートを提供

## 高度な自動化

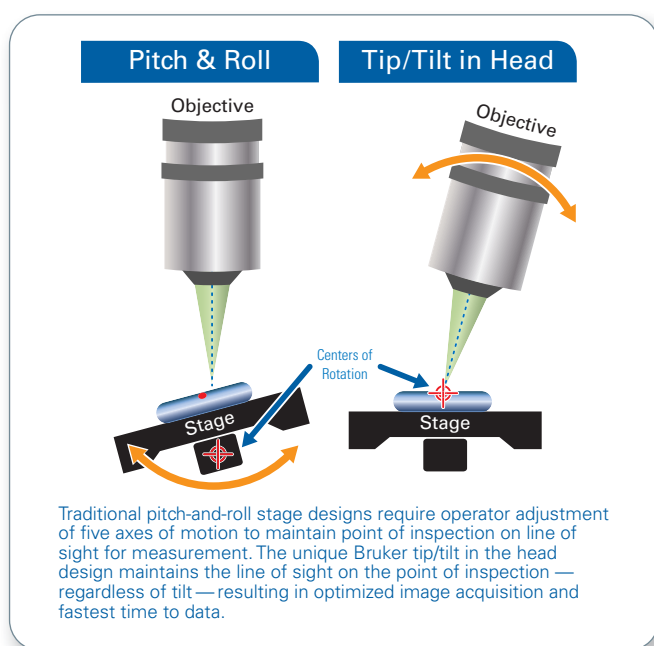
ブルカー独自のティップ/チルトをヘッドに搭載し、比類のない生産のセットアップと検査のためのユーザーの柔軟性を実現するためにオートチップ/チルト機能を光学式にカップリングしたモジュール構造は様々な効果を生みだします。装置の視線の先にある検査点を独立した支点として傾き調整が可能です。

これにより、オペレータの介入が少なくなり、最大限の再現性を実現する組み合わせとなります。駆動部をすべて自動化された仕様のContourX-500は、オンデマンド測定に最適です。コンパクトなフットプリントの中で、産業用の要件をすべて満たしています。

## 最も広いアプリケーション分析機能

パワフルなVisionXpressとVision64ユーザーの活用インターフェイスをもつContourX-200は何千ものラボでの生産性向上のためにカスタマイズされたコンパクトデザインです。

新しくなった高機能カメラと、操作性を向上する為に電動化された柔軟性XYステージは、より柔軟に、より高いスループットを実現します。幅広いサンプルや部品のためにハードウェアとソフトウェアを組み合わせることで、合理化された装置性能は、表面形状の計測技術業界を完全に凌駕します。



## ContourX-500 Specifications

スキャン範囲	≤10 mm
垂直分解能 <sup>1</sup>	<0.01 nm
横分解能	0.38 μm min (スパロー基準); 0.13 μm (with AcuityXR®)
段差測定精度 <sup>2</sup>	<0.75% 段差
段差再現性	<0.1% 1 sigma repeatability
最大スキャン 速度	37 μm/sec (標準カメラ使用時)
反射率範囲	0.05% ~ 100%
サンプル傾斜限界	≤40° (光沢のある表面); ≤87° (粗い表面)
サンプル高さ	≤100 mm (4 in.)
XY サンプルステージ	150 mm (6 in.) 自動操作 エンコーダー制御
Z フォーカシング	100 mm (4 in.) 自動操作
傾斜調整機能	±6° (4 in.) 自動操作 ヘッドチルト構造
光学計測モジュール	特許取得済みのデュアルカラーLED照明 単一対物レンズアダプタ 自動 (オプション) または手動タレットハウジング 電動 (オプション) または手動ディスクリート モジュール
対物レンズ パフォーカル	標準型: 2.5X, 5X, 10X, 20X, 50X, 115X 長作動型: 1X, 1.5X, 2X, 5X, 10X; 環境制御型TTM: 2X, 5X, 10X, 20X; 明視野型: 2.5X, w5X, 10X, 50X
光学ズームレンズ	0.55, 0.75X, 1X 1.5X, 2X
カメラ	白黒 (標準) 5MP カラー (オプション) 5MP (1200x1000 Pixel)
ソフトウェアシステム	Vision64 および VisionXpress 解析 ソフトウェア(Windows 10 OS)
ソフトウェアパッケージ	USI; Advanced PSI; Production Mode; VisionMAP; AcuityXR®; 光学解析; SureVision; Film; MATLAB; SDK, TCP/IP
自動機能	光量 焦点合せ、 解析データ保存、 データベース記録
装置校正	Via NIST/PTB に準拠
設置面積	480 mm (W) x 604 mm (D) x 700 mm (H)
装置重量	70 kg
保証	12 months

<sup>1</sup>SiC リファレンスマイラー上 30回連続測定時の再現性測定 Sq/σ 値。PSI Mode

<sup>2</sup>SiC リファレンスマイラー上 30回連続測定時の再現性測定 Sq/σ 値。PSI Mode

## ● ブルカージャパン株式会社 ナノ表面計測事業部 Bruker Nano Surfaces Division

東京都中央区新川1-4-1  
Phone : 03-3523-6361  
Info-Nano.BNS.JP@bruker.com

[www.bruker.com/ContourX-500](http://www.bruker.com/ContourX-500)